

金相试样双盘磨抛机 MP-2DE



磨抛机的用途与特性

本磨抛机为双盘台式机,适用于对金相试样进行粗磨、精磨和抛光操作。本机采用微处理器控制系统,可直接获得 50-600 转/分钟之间的转速,从而使本机具有更加广泛的应用性。本机具有双控制系统,可供两人同时操作。本机带有冷却装置,可以在研磨抛光时对试样进行冷却,以防止因试样过热而破坏金相组织。该机使用方便、安全可靠,是工厂、科研单位以及大专院校实验室的理想制样设备。

主要技术指标

工作电压: 220V 50HZ

磨抛盘直径: $\Phi 203\text{mm}$ (可订制 $\Phi 230\text{mm}$ 、 $\Phi 250\text{mm}$)

转速: 50-600 转/分钟 (无级变速) 150 转/分钟, 300 转/分钟 两级定速

砂纸直径: 200mm (可订制 $\Phi 230\text{mm}$ 、 $\Phi 250\text{mm}$)

输入功率: 550W*2

外形尺寸: 710×680×330mm

重量: 50KG

控制面板操作方法

- A: 显示屏: 设备上电后, 显示“OK”, 表明系统供电正常。
- B: 启动键: 当系统处于停止状态时, 按下该键, 设备运转。
- C: 停止键: 机器处于运转状态时, 按下该键, 系统停止运转。
- D: 转向键: 在机器处于正向运转过程中, 按下该键机器将改变方向, 为反向运转。
- E: V 键和 2V 键: 是二级定速键。按 V 键, 磨抛盘转速为 150 转/分钟, 按 2V 键, 磨抛盘转速为 300 转/分钟。V 键和 2V 键只能在运转中设定。
- F: Δ 键和 ∇ 键: 为无级调速键, 机器在运转过程中, 按 Δ 键, 转速上升, 按 ∇ 键转速下降。最高转速为 600 转/分钟, 最低速为 50 转/分钟。

结构特性概述

该磨抛机由底座、电机、磨抛盘及控制面板等组成。本机外部由 ABS 外壳罩住, 在外观上更加美观大方, 并提高了防腐、防锈性能。

电动机固定在底座上; 轴通过三角皮带传动; 磨抛盘套在轴上, 由键带动而转动; 开关直接固定在机身上; 水砂纸粘贴或扣压在磨盘上; 可移动的喷水管的流量由旋钮调节控制; 废液可由排水管排出。

初次使用本机时

由于本机磨抛盘与传动轴为锥面联接, 初次使用时, 应用橡皮锤将双盘按轴向方向敲打至紧密配合为佳。否则, 将影响本机的使用性能。

使用方法之一:

研磨将水磨砂纸粘贴或扣压在左侧磨抛盘上。

打开水开关, 并调整好水流。

闭合位于机器后面右侧的电源开关, 显示器显示“OK”, 表示系统已经得电, 处于待机状态。

按动控制面板上的开始键, “RUN” 灯亮, 设备将自动加速至目标转速 (设定目标转速的方法见“控制面板操作方法”)。

按动 Δ ∇ 键, 可在 50r/min-600r/min 区间内任意设定研磨工艺所需要的转速。

将切割或镶嵌好的试样用力持住，并轻轻靠近砂纸，待试样和砂纸接触良好并无跳动时，可用力压住试样进行研磨。

力度大约在不使研磨面因摩擦过热而烧伤组织为佳（大约 2kgf）

工作结束，按停止键，电动机停止运转，断开电源开关，关闭系统电源。

使用方法之二：

抛光将带压敏胶的抛光织物平整地粘贴在右侧抛光盘上，如果是自制的抛光织物，也应平铺于抛光盘上。

将外压圈压在抛光盘外圆上，从而固定住无压敏胶的抛光织物。

将调制好的抛光剂涂于织物上。

闭合位于机器后面右侧的电源开关，显示器显示“OK”表示系统已得电，处于待机状态。

按动控制面板上的开始键，“RUN”灯亮，设备将自动加速至目标转速（设定目标转速的方法见“控制面板的操作方法”）

按动△ ▽键，可在 50r/min-600r/min 区间内任意设定抛光工艺所需要的转速。

将研磨好的试样用力持住，并轻轻靠近抛盘，最初先将试样按向抛光盘的中心位置，边抛光边向外平移试样。

操作中感觉织物粘性很大时，应将抛光剂再调稀一些。

当抛光织物有破损时，应及时更换，以免损坏试样。

工作结束，按停止键，电动机停止运转，断开电源开关，关闭系统电源。

装 箱 单

名 称	规 格	单 位	数 量	备 注
金相试样磨抛机	MP-2DE	台	1	
产 品 说 明 书		份	1	
产 品 合 格 证		份	1	
装 箱 单		份	1	
抛 光 织 物		片	2	
金 相 砂 纸		片	2	



莱州市华兴测试仪器有限公司

地址:山东省莱州市虎头崖工业园

服务热线:0535-2172116

磨 抛 盘		个	2	
铝 扣 圈		个	2	
电 源 线		个	1	
排 水 管		个	1	